

實驗室簡介內容

實驗室名稱：電子顯微鏡實驗室 (Electron Microscope Laboratory)

實驗室地點：M105

負責教師：馬廣仁 Kung- Jeng Ma

簡介：

掃描電子顯微鏡 (英語：Scanning Electron Microscope，縮寫為 SEM)，其工作原理是通過用聚焦電子束掃描樣品的表面來產生樣品表面的圖像。掃描電子顯微鏡可以實現解析度優於 1 奈米，樣品可以在高真空，低真空，濕條件 (用環境掃描電子顯微鏡) 以及寬範圍的低溫或高溫下觀察到。在工程上，電子顯微鏡是材料顯微組織分析使用最平凡且最有效的工具。

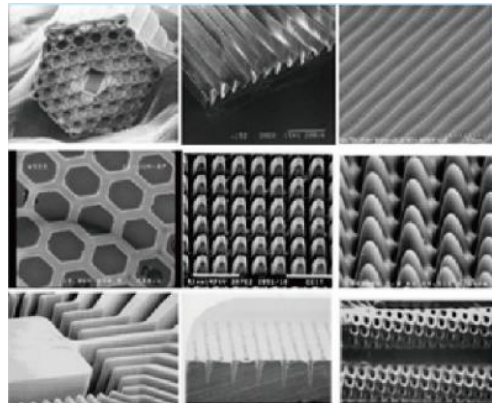
主要研究主題：

- (1) 材料奈微米加工後之表面形貌。
- (2) 一維、二維奈微米結構分析。

設備：一、掃描式電子顯微鏡外觀



二、材料奈微米加工後之表面形貌



三、鍍金機外觀



四、鍍鉑機外觀



研究方向：

1. 材料奈微米結構分析(Nano/Microstructure Analysis of Materials)
2. 奈微米結構表面對親疏水之影響